Phoenics User Conference

in Japan, 2006

Phoenics User Conference in Japan, 2006

マイクロフルイディクスへの適用例

SHIBAURA INSTITUTE

芝浦工業大学工学部
機械工学第二学科
小野直樹(助教授)
鈴村剛史(修士1年)
吉田貴洋(修士1年)





1、マイクロフルイディクスとは?

2、Phoenics適用例

(1)回転流れを用いたマイクロミキサーについて (2)微細撥水面の摩擦抵抗について \$ 3、全体のまとめ



1、マイクロフルイディクスとは?

近年、携帯型のIT機器等の進歩に伴い、半導体分野で進歩した微細加 工技術を用いてマイクロスケールの流体機器や流体マシンを作成する試 みが拡がっている。その適用先として、

1) MEMS(Micro Electro-Mechanical System), Power MEMS

2) μ -TAS(micro Total Analysis System)

3)Lab-on-a-chip

4) DDS(Drug Delivery System)

などがあり、その他種々開発が進んでいる。

→このようなマイクロ流体システムに関する流体工学分野のことを

マイクロフルイディクス(Microfluidics)と呼び、最近注目されている。



2、Phoenics適用例 その1

(1)回転流れを用いたマイクロミキサーについて

Micro mixer とは・・・ µ-TASなどで使用される、ダウンサイジングの効果を積極的に利用した微小な液混合器

micro化の利点

A液

B液

- 1. 比界面積が大きくなるため、分子拡散を効率的に行え、時間の短縮ができる。
- 2. 試薬や廃液の低減ができる。
- 3. システムの小型化が可能。

従来の混合器

↓ 従来型のミキサーの典型的な例 OF TE<u>CHNOLOGY</u>

> 「問題点 液体の混合は液ー液界面の分子拡散でしか 起こらず、時間がかかる。



(1)新たなMixerの提案 回転流れを発生させ液一液界面を増加させ、分子拡散による 液体の混合を促進させ既存のmixerより効率のよいmixerを提 案できないか検討する。

(2)特性の検証回転流れを用いたmixerの特性を検証する。

(3)形状の検討
 回転流れを用いた混合をより
 効率よく行える形状のmixerを
 検討する。







PHOENICSを用いてシミュレーションを行い、計算結 果を以下のように評価した。

•評価方法 Micro mixerの評価法は確立され ていない。そこで独自の評価法を使 用した。定常計算を行い、流出ロで の濃度差と圧力損失(流入口と流 出口の圧力差)で評価する。流入速 度を変化させ、平均滞留時間—濃 度差・圧力損失のグラフを作成。

平均滞留時間とは・・・Mixerの容積に 関係なく、形状の特性について評価が できる。

 $t(m \sec) = \frac{V(mm^3)}{Q(mm^3/m \sec)}$









◆ 流入させる2流体は水とし、物性値の違いはないものとする。

◆ 化学変化は考慮しない。

◆ 流入させる流体の濃度は1、0とし拡散係数は 液体の拡散係数の一般的なオーダーとしてア ンモニアと水の拡散係数を用いた。

◆ 流出ロメッシュは10×10とし、濃度の値の最大値と最小値から濃度差を求める。

出口メッシュの濃度の Max-Min

流速V(m/sec)	0.001~10.00
密度	998.23
動粘度 ν (m²/sec)	1.006 × 10 ^{−6}
レイノルズ数Re	0.1~1000
拡散係数D(m²/sec)	1.23 × 10 ^{−9}

座標系	直交座標
計算モデル	Laminar(層流モデル)
繰り返し計算回数	10000回(計算結果に誤差が出 ない程度に十分長く)
計算時間	約2時間
メッシュ数	(X,Y,Z)=(60,60,15)









混合器の厚みの変化による比較





流入口断面積の違いによる比較







- 回転流れを用いたmixerでは、一般的なmixerと比較して、 高流速域での混合が期待できる。しかし低流速域では溶 液の混合に適していない。ただし混合が期待できる領域で は圧力損失が大きくなる傾向にある。
- 2. 渦流を3次元的にし、渦の回転数を増やすため、ある程度 厚みを持たせたほうが混合効率が良い。
- 3. 流体の比表面積、渦の回転数が増えるためMixerに対して 流入口の断面積が小さいほうが効率が良い。ただし圧力 損失は大きくなる。



B.-H. Jo et at., J. of MEMS, Vol.9, No.1, March(2000), p76.



流れの可視化例(流速u=1.0m/s)



SHIBAURA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Standard model Model.3 (回転流れを用いた基本モデル) (厚み無しモデル)





Probe value 0.000000



micro_model.1



Standard model (本研究基本モデル)

Model.3 (流入路断面積を1/4にしたモデル)



12、Phoenics適用例 その2

(2) 微細 撥水面の 摩擦抵抗について

表面張力を利用したはっ水面の研究→マイクロレベルでの加工技術 の発達により可能になる。

同様の形状をマイクロチャネル(微細流路)に活かせないかを考え、 微細流路内の壁面を表面張力で保持するモデルを作り、数値解 析を行う。





微細流路における粘性抵抗の低減をめざして、 壁面摩擦損失の低減に対する、

(1)表面張力で支持する溝長Iによる影響(2)一定の面積比の流路における溝の刻み方の違いの影響

について数値モデルを用いて検討する。





・溝長、位置・パターン等を変化させた2次元のモデル流路を 作成し、壁面部のせん断応力、せん断力、流速を抽出。

3-1.溝長変化の計算

0.025mmから0.225mmまで0.025mm刻みで 溝長を変化させて計算。入り口流速は0.02m/sで一定。





3-2.位置・パターン変化の計算

単位流路長あたりの溝なしモデルに対する面積比を55%と80%に 固定し、55%の時は4種、80%の時は3種の流路パターンを作成、 入り口流速vを0.02m/s、0.2m/s、2m/sに変えて計算。

3-2-1 面積比55%の流路モデル



ogy





(1)壁面部におけるせん断応力

(1-1)せん断応力のピーク値が溝部の前端と後端に見られる



(1-2)**溝部における圧カコンタ図と速度ベクトル図を観る** 溝の前端部では圧力が下がり、流路中心部から流れが広がってくる。 また、流れ後端部では壁面部での速度の遅い流れに乗り上げ、中心部に集まる。



(1-3)溝長の変化によってせん断応力はどの様に変化するか



(2)溝の位置・パターンの変化で壁面抵抗は どのように変わるか

■(2-1)溝なしモデルと溝ありモデルの壁面抵抗の差を 抵抗低減率として55%と80%の各モデルについて評価

抵抗低減率[%]=(構ありモデルのせん断力-溝なしモデルのせん断力) 溝なしモデルのせん断力

Table1 溝長変化の場合の抵抗低減率					
		抵抗低減率 [%]			
	流速[m/s] 溝長[mm]	0.02	0.2	2	
	溝なし	0	0	0	面積比が同じでも・・・
	0.05	13.0	12.1	9.2	
	0.15	25.6	20.1	13.5	
	0.225	30.2	23.2	15.6	洋戸が戸いせが
	0.45	36.1	28.4	19.2 🔨	神女が女い力が
	0.05(80%)	4.6	3.7	1.8	抵抗低減率が大きくなる
	0.1	9.6	6.7	3.0	
	0.2	13.2	9.1	4.4	

(2-2)なぜ溝長が長い方が抵抗低減率が大きくなるのか 面積比55%入り口流速0.2m/sの条件で

溝長I=0.05mmとI=0.225mmの場合のせん断応力を比較する





壁面抵抗をより小さくするためには

(1)溝長の総和を大きくし、 壁面が占める面積比を小さくする。

(2)溝を小刻みにするのではなく、 溝数が少なくても各溝長を長く取る。

→今後は、3次元形状の効果やメニスカス部分の 影響などを含めたさらなる検討が必要である。



全体のまとめ(個人的な意見ですが、)

Phoenics User Conference

in Japan, 2006

(1)マイクロフルイディクスの分野でのPhoenicsの 適用例を示した。

(2)マイクロスケールの流れでの精密な流速や濃度、温度の測定は簡単ではない。数値モデルを用いて検討しておくことは非常に重要である。

S (3)併せてマイクロスケールの実験技術、測定技術 の進歩も望まれ、数値計算と実験結果を迅速かつ 簡便に比較検討できるシステムが望まれる。